

## 微加工实验室设备收费标准：

仪器名称	品牌型号	收费标准
电子束曝光系统	Raith150	1500 元/小时
电子束扫描/直写系统	eLINE Plus	1500 元/小时
高电压电子束曝光系统	EBPG 5200	2000 元/小时
高电压电子束曝光系统	JBX-6300FS	1500 元/小时
紫外曝光设备	MA6	1200 元/小时
DTL 光学曝光设备	PhableR 100S	1200 元/小时
激光直写设备	DWL66+	1200 元/小时
聚焦离子束双束系统	Helios 600i	2000 元/小时
聚焦离子束双束系统	NX5000	2000 元/小时
氦氛离子显微镜	ORION NanoFab	1500 元/小时
飞秒激光三维直写设备	Photonic Professional	1200 元/小时
纳米压印	Eitre-3	800 元/小时
电子束蒸发沉积	Peva-600E	普通金属 1600 元/次， 贵金属 2800 元/次。 超过 200nm 的部分， 每增加 50nm，加收 500 元。
电子束蒸发沉积	FU-12PEB	
富氧电子束蒸发沉积	FU-12PEB-500	
热蒸发	FU-12PEB-500	
超高真空磁控溅射镀膜机	JSP-4	
离子束溅射沉积	ZNDJ-100-F100	
超高真空多腔室电子束蒸发镀膜系统	JEB-4	1000 元/小时
等离子体增强化学气相沉积	System100 PECVD	1200 元/小时
等离子体增强化学气相沉积	PD-220NL	1200 元/小时
电感耦合等离子体增强化学气相沉积	SI 500D	1200 元/小时
原子层沉积	Savannah-100	800 元/小时
原子层沉积	Exploiter E200SP	800 元/小时
等离子体辅助原子层沉积	TorVacT200	800 元/小时
晶圆光刻预处理	310TA	800 元/小时
反应离子刻蚀	Plasmalab80Plus	600 元/小时
反应离子刻蚀	PlasmaPro NGP80	600 元/小时
反应离子刻蚀	RIE-200NL Dual	600 元/小时
反应离子束刻蚀	HassrodeLoremR	1200 元/小时
电感耦合等离子体金属刻蚀	Haasrode Pishow A	1200 元/小时

电感耦合等离子体刻蚀	PlasmalabSystem100	1200 元/小时
电感耦合等离子体 III-V 族刻蚀	SENTECH SI 500	1200 元/小时
电感耦合等离子体深硅刻蚀	RIE-400iPB	1200 元/小时
电感耦合等离子体深硅刻蚀	PlasmaPro100Cobra	1200 元/小时
离子束刻蚀	LLK-150E	600 元/小时
微波等离子体去胶机	ASTRO PACTO-10G	600 元/小时
微波等离子体去胶机	ASTRO PACTO-16Q	600 元/小时
超高分辨场发射扫描电镜	Regulus 8230	600 元/小时
扫描探针显微镜	Dimension Edge	600 元/小时
表面形貌仪 (台阶仪)	Dektak XT	600 元/小时
白光干涉表面轮廓仪	Contour GT	600 元/小时
白光干涉表面轮廓仪	VS 1800	600 元/小时
激光共聚焦显微镜	OLS5100	600 元/小时
椭偏仪	ME-Mapping	600 元/小时
椭偏仪	SE-VE-L	600 元/小时
薄膜应力测试仪	FST5000-M8	600 元/小时
低温四探针电学测试平台	美国 Janis 探针台	400 元/小时
四探针电学测试系统	EPS150	400 元/小时
半导体特性测量系统	Keithley 4200 SCS/F	400 元/小时
微区角分辨光谱测试系统	ARMS	800 元/小时
超表面光场检测系统	定制	800 元/小时
傅立叶变换光谱仪	Bruker Hyperion/Vertex 80v	200 元/谱
快速退火炉	AccuThermo AW410	600 元/小时
快速退火炉	RTP-200-HT	600 元/小时
超声波引线仪	7476D	600 元/小时
超声波引线仪	F&K5430	600 元/小时
激光切片机	HDZ-GCF-1000-3025	600 元/小时
砂轮切片机	DAD323	600 元/小时
砂轮切片机	DAD3351	600 元/小时

